

各位同仁：以下所附為本學期：

- (1) 課程教學助教申請表，請於申請表內提出助教明確工作內容及需有的背景（如：需修習過之科目），助學金委員會將依據各位同仁申請表所填寫之需求公告公開遴選助教候選人。系辦將彙整欲申請助教之研究生資料交各任課教授進行遴選，並將遴選結果通知助學金委員會並公告之。
- (2) 研究生申請學習本系各貴重儀器之申請表
- (3) 開放式實驗室及相關儀器維護保養所需助理申請表(僅適用通過申請之人員)

助學金委員會將依據各位同仁申請之需求編列今年下半年教學及研究助理之預算。

教學與研究助學金之發放除了要適才適所外，還有一個原則便是普及化，我們希望助學金的發放不要集中在少數同學身上，因此請各位同仁在選擇工作人員時也考慮到這一點。比如說一位同學如果已經做了相當時數貴儀助教的話，就最好不要再找這位同學做其他助教(理)的工作，另外我們也不希望研究生花太多時間在工讀上，故依系務會議決議研究生每月所領之助學金碩士生上限為 8,000 元、博士生上限為 12,000 元(依本系 103 學年度第 6 次系務會議決議)，這一點拜託大家多注意一下。

※ 煩請您於   月 日(星期 ) 前將相關申請表交 系辦陳秀玉小姐 彙整。

謝謝幫忙！

材光系獎助學金委員會\_\_\_\_\_敬上 年 月 日

課程教學助教申請表(TA Application) 第 2 階段申請

- 請注意：(1) 學校要求碩士班課程助教須由**博士班研究生**擔任  
 (2) 課程教學助教的申請以修課人數達**15人以上**為原則，實驗性課程不在此限  
 (3) 全職助教每月領 6,000 元，半職助教每月領 3,000 元，一學期發**三個月**助教費  
 (4) **平均每週工作 4 至 5 小時者請申請全職助教一名**，**2 至 3 小時者請申請半職助教一名**  
 (5) 助教人選請考慮普及化之原則

課程名稱：\_\_\_\_\_ 一般類 ; 申請人：\_\_\_\_\_ (親簽)  
實驗類

開課年級：研究所 大學部\_\_\_\_\_年級 修課人數：\_\_\_\_\_人 (加退選前)  
必修 多門必修 選修

工作內容	需修過之相關課程	助教需求數
範例： (1)每次上課準備及清潔教具設備。(TA 例行職責) (2)本學期需改 4 次作業，每次作業約有 10 題習題。 (3)負責回答修課同學所有課本習題之相關問題。 (4)平均每週工作 4~5 小時。	範例： 物理冶金或材料科學導論	範例： 全職： 1 名 半職： 名
填寫於下：(必填) 【其他 TA 之例行職責，請參國立中山大學 TA 守則】 (1)每次上課準備及清潔教具設備。 (2)	填寫於下：(必填)	全職： 名 半職： 名

※上列資料由申請教授填寫

修課人數：\_\_\_\_\_人 (加退選後)

一般類課程加退選後修課人數低於 15 人者收回 TA 員額

**以下遴選結果於助學金委員確認符合申請標準後彙整填寫，並由助學金執行委員簽名後，始公告之。**

助教名單： 助學金執行委員：\_\_\_\_\_ (簽名)

※下列助教名單申請教授請勿填寫

全職:\_\_\_\_\_名; 助教姓名：\_\_\_\_\_，就讀年級：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，就讀年級：\_\_\_\_\_

半職\_\_\_\_\_名; 助教姓名：\_\_\_\_\_，就讀年級：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，就讀年級：\_\_\_\_\_

**3010 TEM 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請 JEOL 3010 TEM 使用執照需符合下列資格：

- a. 材光系碩士班以上學生
- b. 經指導教授特別註明研究計畫有需求並經儀器負責教授同意者，並通過筆試檢定(由儀器負責教授出題考核)或修習通過本系開設之電子顯微鏡學課程後，方可報名學習 JEOL 3010 TEM。
- c. JEOL 3010 TEM、CM-200、Tecnai-FTEM 每學期僅能擇一學習。

註：高分子研究請勿使用 3010。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 張志溥

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

	【博、碩、學/年級】		儀器負責教授勾選區
第一順位姓名：_____	【            】	<input type="radio"/> <small>未修課 需筆試</small>	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第二順位姓名：_____	【            】	<input type="radio"/> <small>未修課 需筆試</small>	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第三順位姓名：_____	【            】	<input type="radio"/> <small>未修課 需筆試</small>	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第四順位姓名：_____	【            】	<input type="radio"/> <small>未修課 需筆試</small>	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

**Field-Emission TEM 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_年\_\_月\_\_日

申請 Tecnai-FTEM 使用執照需符合下列資格：

- a. 中山材料與光電科學學系研究生。
- b. 修畢本系開設之電子顯微鏡課程及格。
- c. JEOL 3010 TEM、CM200、Tecnai-FTEM 每學期僅能擇一學習。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 張志溥

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

【博、碩、學/年級】

儀器負責教授勾選區

第一順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  未修課  (可學;不可學)

第二順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  未修課  (可學;不可學)

第三順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  未修課  (可學;不可學)

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

CM-200 使用執照學習申請表 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請 CM-200 使用執照需符合下列資格：

- a. 材光系碩士班以上學生
- b. 經指導教授特別註明研究計畫有需求並經儀器負責教授同意者，並通過筆試檢定(由儀器負責教授出題考核)或修習通過本系開設之電子顯微鏡學課程後，方可報名學習 CM-200 TEM。
- c. JEOL 3010 TEM、CM-200、Tecnai-FTEM 每學期僅能擇一學習。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 陳智彥

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

	【博、碩、學/年級】		儀器負責教授勾選區
第一順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="radio"/> 未修課 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第二順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="radio"/> 未修課 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第三順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="radio"/> 未修課 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第四順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="radio"/> 未修課 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第五順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="radio"/> 未修課 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第六順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="radio"/> 未修課 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

**XRD-D2 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注意事項：

- a.申請上學期學習 XRD-D2 X 光繞射儀同學，必須選修本系碩士班 X 光繞射課程，與參加當學期舉辦之輻射安全講習，學期末通過 X 光繞射課程、取得輻安執照者並通過操作考試才可獲得使用執照。
- b.申請下學期學習 XRD-D2 X 光繞射儀同學，必須已經通過本系碩士班 X 光繞射課程，並取得輻射安全講習證照。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 周明奇

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

	【博、碩、學/年級】	儀器負責教授勾選區
第一順位姓名：_____	【            】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ,不可學 <input type="checkbox"/> )
第二順位姓名：_____	【            】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ,不可學 <input type="checkbox"/> )
第三順位姓名：_____	【            】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ,不可學 <input type="checkbox"/> )
第四順位姓名：_____	【            】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ,不可學 <input type="checkbox"/> )
第五順位姓名：_____	【            】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ,不可學 <input type="checkbox"/> )
第六順位姓名：_____	【            】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ,不可學 <input type="checkbox"/> )

- 註:1. D-2 為粉末繞射儀，適用於粉末或多晶塊材的相分析與結構鑑定。已取得 D2 使用執照者，如需使用 HR-D8 或 PF-D8，仍須由 B 級開始學習。
- 2.通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器，相關規定同注意事項，並可以大學部之晶體結構與 X 光繞射課程抵免（學期成績 70 分以上）。
  - 3.儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
  - 4.五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
  - 5.學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

**XRD-D8 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注意事項：

- a.申請上學期學習 Bruker D8 X 光繞射儀同學，必須選修本系碩士班 X 光繞射課程，與參加當學期舉辦之輻射安全講習，學期末通過 X 光繞射課程、取得輻安執照者並通過操作考試才可獲得使用執照。
- b.申請下學期學習 Bruker D8 X 光繞射儀同學，必須已經通過本系碩士班 X 光繞射課程，並取得輻射安全講習證照。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 周明奇

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

【博、碩、學/年級】

儀器負責教授勾選區

第一順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  (可學;不可學)

**HR-D8**：  (a) B 級(GID)、  (b) A 級(HR scans) 或  **PoleFigure-D8**

第二順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  (可學;不可學)

**HR-D8**：  (a) B 級(GID)、  (b) A 級(HR scans) 或  **PoleFigure-D8**

第三順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  (可學;不可學)

**HR-D8**：  (a) B 級(GID)、  (b) A 級(HR scans) 或  **PoleFigure-D8**

第四順位姓名：\_\_\_\_\_ 【            】  (可學;不可學)

**HR-D8**：  (a) B 級(GID)、  (b) A 級(HR scans) 或  **PoleFigure-D8**

- 註：1. HR-D8 適用於薄膜或磊晶試片，使用 Cu-K x-ray，具備 GID, XRR, RSM, HR phi/omega/2 theta scan 等功能，PF-D8 適用於多晶塊材，特別是鋼鐵材料。使用 Co-K x-ray，具備 pole figure, inverse pole figure 量測與 ODF 計算功能。已取得 D2 使用執照者，如需使用 HR-D8，仍須由 B 級開始學習。
- 2.通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器，相關規定同注意事項，並可以大學部之晶體結構與 X 光繞射課程抵免（學期成績 70 分以上）。
- 3.儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
- 4.五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
- 5.學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

**Field emission SEM 6330 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請 6330SEM 使用執照需符合下列資格：

- a. 低溫 CL 限博士班考照，常溫則不設限。
- b. 需有 6330SEM C 級執照方得報名 B 級。

推薦學習名單：

**儀器負責教授：**\_\_\_\_\_ 張六文

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

【博、碩、學/年級】

儀器負責教授勾選區

第一順位姓名：_____	【	_____	】	<input type="checkbox"/>	(可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習證照 (請勾選)：	<input type="checkbox"/>	(a) C 級	<input type="checkbox"/>	(b) B 級	( <input type="checkbox"/> ECCI/ <input type="checkbox"/> EBSD/ <input type="checkbox"/> CL)
第二順位姓名：_____	【	_____	】	<input type="checkbox"/>	(可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習證照 (請勾選)：	<input type="checkbox"/>	(a) C 級	<input type="checkbox"/>	(b) B 級	( <input type="checkbox"/> ECCI/ <input type="checkbox"/> EBSD/ <input type="checkbox"/> CL)
第三順位姓名：_____	【	_____	】	<input type="checkbox"/>	(可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習證照 (請勾選)：	<input type="checkbox"/>	(a) C 級	<input type="checkbox"/>	(b) B 級	( <input type="checkbox"/> ECCI/ <input type="checkbox"/> EBSD/ <input type="checkbox"/> CL)
第四順位姓名：_____	【	_____	】	<input type="checkbox"/>	(可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習證照 (請勾選)：	<input type="checkbox"/>	(a) C 級	<input type="checkbox"/>	(b) B 級	( <input type="checkbox"/> ECCI/ <input type="checkbox"/> EBSD/ <input type="checkbox"/> CL)
第五順位姓名：_____	【	_____	】	<input type="checkbox"/>	(可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習證照 (請勾選)：	<input type="checkbox"/>	(a) C 級	<input type="checkbox"/>	(b) B 級	( <input type="checkbox"/> ECCI/ <input type="checkbox"/> EBSD/ <input type="checkbox"/> CL)
第六順位姓名：_____	【	_____	】	<input type="checkbox"/>	(可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習證照 (請勾選)：	<input type="checkbox"/>	(a) C 級	<input type="checkbox"/>	(b) B 級	( <input type="checkbox"/> ECCI/ <input type="checkbox"/> EBSD/ <input type="checkbox"/> CL)

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

**AES/XPS 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請 AES/XPS 使用執照需符合下列資格：

- a. 所有本系研究所學生修習通過本所開設之電子顯微鏡學和 X 光與電子能譜學者，皆可報名參加 AES/XPS 之 B 級證照學習。
- b. 經指導教授特別註明研究計畫有需求，通過筆試後可報名參加 AES/XPS 之 B 級證照學習。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 張六文

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

	【博、碩、學/年級】	○ 未修課 需筆試	<div style="border: 1px solid purple; padding: 2px; display: inline-block;">儀器負責教授勾選區</div> <input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> )、不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
第一順位姓名：_____ 【            】			<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> )、不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習項目 (請勾選)： <input type="checkbox"/> (a) AES； <input type="checkbox"/> (b) XPS			
第二順位姓名：_____ 【            】			<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> )、不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習項目 (請勾選)： <input type="checkbox"/> (a) AES； <input type="checkbox"/> (b) XPS			
第三順位姓名：_____ 【            】			<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> )、不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習項目 (請勾選)： <input type="checkbox"/> (a) AES； <input type="checkbox"/> (b) XPS			
第四順位姓名：_____ 【            】			<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> )、不可學 <input checked="" type="checkbox"/> )
學習項目 (請勾選)： <input type="checkbox"/> (a) AES； <input type="checkbox"/> (b) XPS			

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

**2100 TEM 使用執照學習申請表** 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請 JEOL 2100 TEM 使用執照需符合下列資格：

- a. 材光系碩士班以上學生
- b. 經指導教授特別註明研究計畫有需求並經儀器負責教授同意者，並通過筆試檢定(由儀器負責教授出題考核)或修習通過本系開設之電子顯微鏡於軟物質研究之應用課程(80 分以上)後，方可報名學習 JEOL 2100 TEM。

註：非有機及高分子材料研究請勿使用 2100。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 蔣西旺

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

	【博、碩、學/年級】		儀器負責教授勾選區
第一順位姓名：	_____【      】	<input type="radio"/> 未修課 <input type="radio"/> 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第二順位姓名：	_____【      】	<input type="radio"/> 未修課 <input type="radio"/> 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第三順位姓名：	_____【      】	<input type="radio"/> 未修課 <input type="radio"/> 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第四順位姓名：	_____【      】	<input type="radio"/> 未修課 <input type="radio"/> 需筆試	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。

場發射 EPMA 使用執照學習申請表 第 2 階段申請

指導教授：\_\_\_\_\_ (親簽) 申請日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請高解析電子微探儀(JXA-8530F)使用執照需符合下列資格：

- a. 本系碩博士班學生，於取得 SEM C 級執照後可報名參加 EPMA 之證照實習。  
(無 SEM C 級執照者請勿申請)。

推薦學習名單：

儀器負責教授：\_\_\_\_\_ 謝克昌

(需請儀器負責教授勾選可學習名單後，由系辦交技術員彙整)

	【博、碩、學/年級】	儀器負責教授勾選區
第一順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第二順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第三順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )
第四順位姓名：_____	【 _____ 】	<input type="checkbox"/> (可學 <input checked="" type="checkbox"/> ;不可學 <input type="checkbox"/> )

- 註：1. 通過五學年學、碩士學位申請之預研究生，於選定指導教授後，可於大四時申請學習本系儀器。  
2. 儀器使用執照學習名單，經指導教授同意後，須再經各儀器負責教授同意，始可學習儀器。(上述二點經材料所 95 學年度第 4 次所務會議通過)。  
3. 五學年學、碩士學位之預研究生必繳交「就讀研究所之指導教授同意書」後方能申請儀器學習。(經 101 學年度第 2 次系務會議通過)。  
4. 學習名單如經該儀器技術員排入學程表後即不得再更換學習人員名單，故推薦學習名單之順位請慎填。